

EMPA Thun
Werkstofftechnologie
Sekretariat
Feuerwerkerstrasse 39
CH-3602 Thun

■ Organisatorisches

- Ort: EMPA Thun
Feuerwerkerstrasse 39
CH-3602 Thun
Tel. +41-(0)33-228 46 26
Fax. +41-(0)33-228 44 90
- Datum: **Freitag, 15. Juni 2001**
9.45 – 16.00
- Kosten: 170.- Mitglieder SVMT / SGO
200.- Nichtmitglieder
130.- Studierende
inkl. Getränke und Mittagessen
- Anmeldung: Bis 28.5.2001 mit beiliegendem Talon
per Brief oder Fax an obenstehende
Adresse, oder per e-Mail an
katrin.gurtner@empa.ch
- Auskünfte: Katharina Thoma
Tel. +41-(0)33-228 44 97
katharina.thoma@empa.ch
- Anreise: Auto:
Autobahnausfahrt Thun Süd,
Wegweiser «Militärbetriebe»,
General Herzog Haus
Öffentl. Verkehrsmittel:
Ab Bahnhof Thun bei STI
Bus No. 4 Lerchenfeld
Bis Station «Waldeck» (ca. 10 Min.)
Wegweiser EMPA Thun folgen

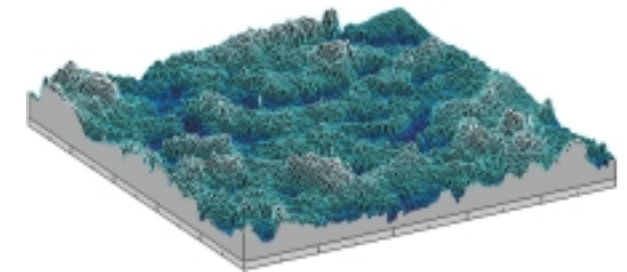


General Herzog Haus



Von der Rauhgigkeit zur Topographie

Messtechnik und Anwendung



EMPA Thun
Werkstofftechnologie
www.empa.ch/abt126

Freitag, 15. Juni 2001
9.45 – 16.00

Von der Rauigkeit zur Topographie Messtechnik und Anwendung

■ Inhalt und Zielsetzungen:

Oberflächen-Qualitätskontrolle, Strukturierung von Oberflächen, Analyse von beanspruchten Oberflächen: Dies sind nur einige der Anwendungen verschiedener Methoden der Topographiemessung.

Die Veranstaltung möchte einen Überblick geben über die Möglichkeiten und Einsatzbereiche verschiedener Messtechniken vom Zentimeter zum Nanometer.

Wir möchten möglichst viele Anwender, Anbieter und Interessenten für Topographiemessung zusammenbringen, um einen breiten Austausch von Wissen und Erfahrung zu ermöglichen.

■ Zielpublikum /TeilnehmerInnen:

AnwenderInnen optischer und mechanischer Topographiemessmethoden. Herzlich eingeladen sind aber auch alle Interessierten, welche sich über Möglichkeiten, Anwendungen und Probleme der Topographiemessung informieren möchten.

■ Ausstellung

Drei Anbieter werden ihre Geräte zur Topographiemessung ausstellen und für kurze Demonstrationen zur Verfügung stehen:

Nanosurf: Raster-Kraftmikroskopie
Cotec: Weisslichtprofilometrie
Alicona: 3D-Raster-Elektronenmikroskopie

■ Sprache:

Die Referate werden grösstenteils in deutscher Sprache gehalten. In den anschliessenden Diskussionen ist jede Landessprache sowie Englisch willkommen.

■ Programm

09.45 Registrierung, Kaffee und Ausstellung
10.15 Begrüssung
L. Rohr, EMPA Thun

Messtechnik – Wie messe und beschreibe ich eine Oberfläche

10.20 Topographiemessung vom Zentimeter zum Nanometer in der Werkstofftechnologie
K. Thoma, EMPA Thun
10.40 Moderne optische Methoden der Topographiemessung und ihre Anwendung
T. Marbach, Hilpert Electronics
11.05 Interpretation von Topographiemessgrössen
S. Siegmann, EMPA Thun
11.25 Kaffeepause
11.45 Mikrotopographische Analyse mit Weisslicht
E. Bellanger, Cotec Contrôle Applications
12.10 Raster-Kraftmikroskopie - Qualitätskontrolle bei Oberflächen mit kleinen Rauigkeiten ($R_a < 0.4 \mu\text{m}$)
L. Scandella, Nanosurf AG
12.35 3D Oberflächenmessung aus stereoskopischen REM-Aufnahmen
Manfred Prantl, Alicona Imaging
13.00 Lunch, Ausstellung

Anwendungen – Interpretation von Oberflächenstruktur und Rauigkeitswerten

14.00 Anwendungen der Topographiemessung: Besichtigung der EMPA –Labors
15.00 Oberflächenqualität in der Medizintechnik: Messung und Interpretation
D. Delfosse, Mathys Medical Ltd.
15.20 Topographie und Tribologie im Maschinenbau
S. Rollier, EMPA Thun
15.40 Diskussion / Ausstellung
16.00 Ende der Veranstaltung

Anmeldung

Von der Rauigkeit zur Topographie

Messtechnik und Anwendung

Freitag, 15. Juni 2001, 9.45 – 16.00

EMPA Thun, Feuerwerkerstrasse 39, 3602 Thun

Anmeldung bitte bis spätestens **28. Mai 2001** mit Talon per Brief oder Fax (+41-(0)33-228 44 90) oder per e-Mail an katrin.gurtner@empa.ch

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Berücksichtigung nach Eingangsdatum der Anmeldung.

Kostenbeitrag:	Mitglieder SVMT / SGO	sFr. 170.-
	Nichtmitglieder	sFr. 200.-
	Studierende	sFr. 130.-
	inklusive Lunch und Getränke	

Name _____

Vorname _____

Funktion _____

Firma _____

Strasse _____

PLZ / Ort _____

Telefon _____

Fax _____

e-Mail _____

Anz. Personen _____

Bemerkungen _____